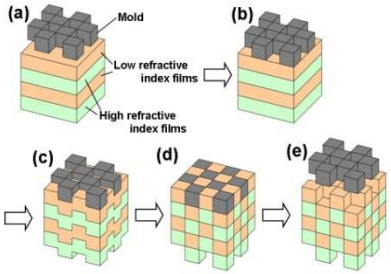
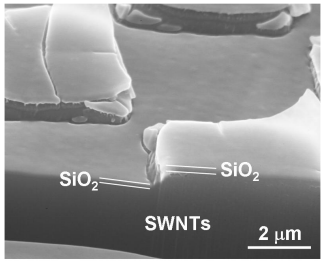
大面積光学素子の高スループット転写技術の開発

事業推進担当者：中尾政之（機械工学専攻）

ディスプレイ、照明機器、センサなどの大面積光学素子を高スループットで転写可能なナノインプリント技術を開発する。

せん断加工を用いた多層光学素子の加工技術





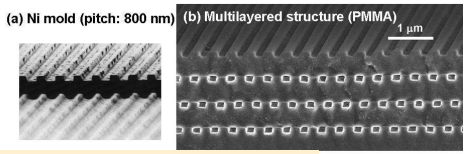
丸山茂夫

T. Hamaguchi et al., *J. Vac. Sci. Technol. B* 26 (2008) 1771.

ローラナノインプリントを用いた大面積光学センサの開発

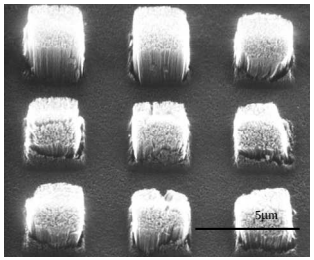
ＪＪドロネー

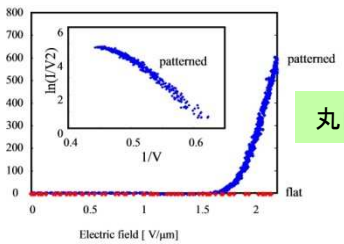
山田一郎



K. Nagato et al., *Microelectron. Eng.* 87 (2010) 1543.

カーボンナノチューブのフィールドエミッションデバイスのためのプレス技術

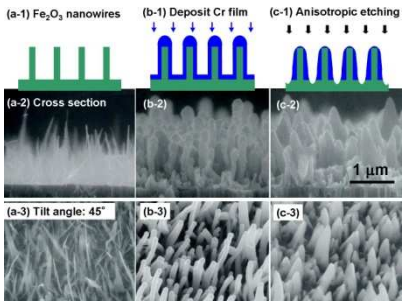


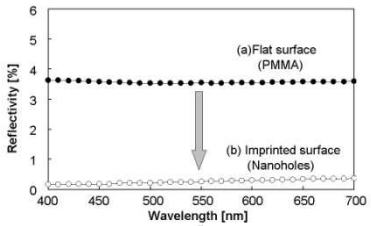


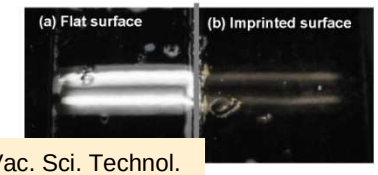
丸山茂夫

K. Nagato et al., *Microelectron. Eng.* submitted.

ナノワイヤを用いた反射防止構造の生成・転写







石原直

K. Nagato, et al., J. Vac. Sci. Technol. B 28 (2010) L39.